سلة تنظيف رقائق السيليكون المربعة القابلة للتخصيص من مادة Ptfe والسيليكون لعمليات التخليل الرطب للشبه موصلات والتعامل مع الركائز

رقم العنصر: PL-CP88

مقدمة

سلال تنظيف مربعة عالية النقاء مصممة من مادة PTFE لمعالجة رقائق السيليكون. تضمن هذه الحاملة المقاومة للتآكل عمليات التخليل الرطب والتعامل الآمن مع الركائز في تصنيع أشباه الموصلات. تتوفر أبعاد وتكوينات قابلة للتخصيص بالكامل لتلبية متطلبات مقاعد العمل الرطبة المختبرية أو الصناعية المحددة.

اعرف المزيد

التطبيق	الوصف	الفائدة الرئيسية
تصنيع أشباه الموصلات	غمر رقائق السيليكون في محاليل تنظيف RCA أو تخليل بيرانا لإزالة الملوثات.	خطر تلوث معدني صفري
إنتاج الخلايا الكهروضوئية	التعامل مع رقائق الطاقة الشمسية كبيرة الحجم أثناء مراحل التنميش والتلميع الحمضي.	إنتاجية عالية الحجم ومتانة
معالجة أجهزة MEMS	نقل آمن للركائز الدقيقة الكهربائية الميكانيكية عبر مقاعد العمل الرطبة المختلفة.	تحديد موقع دقيق للركيزة
تنظيف زجاج LCD/OLED	تنظيف ركائز الزجاج الموصلة (ITO/FTO) قبل ترسيب الأغشية الرقيقة.	مقاومة كيميائية لمنظفات الزجاج
البحث المخبري عالي النقاء	حمل العينات أثناء تحليل النقاء وعمليات الهضم الكيميائي المسببة للتآكل.	مقاومة متفوقة للوسائط المسببة للتآكل
ركائز تكنولوجيا النانو	معالجة رقائق السيليكون على العازل (SOI) أو رقائق الياقوت في بيئات البحث.	تعامل لطيف مع المواد الهشة

فئة المواصفات	تفاصيل المعامل لـ PL-CP88
معرف الموديل	PL-CP88
المادة الأساسية	بولي تترافلوروإيثيلين (PTFE) عالي النقاء
الأبعاد القياسية	249 مم × 249 مم (الأحجام المخصصة متوفرة حسب الطلب)
الهندسة	تصميم سلة زهرية بإطار مربع
خيارات التخصيص	كمية الفتحات، عرض الفتحة، عمق الفتحة، المسافة بين الفتحات، ونمط المقبض
نطاق درجة حرارة التشغيل	-200 درجة مئوية إلى +260 درجة مئوية
المقاومة الكيميائية	عالمية (باستثناء المعادن القلوية المنصوهرة والفلور عالي الضغط)
طريقة التصنيع	تشغيل دقيق من البداية إلى النهاية بواسطة التحكم الرقمي الحاسوبي (CNC) للمواصفات ذات التسامح العالي
تشطيب السطح	تشطيب سلس غير مسامي من مادة الفلوروبوليمر
التوافق	أحواض الغمر اليدوية وأذرع مقاعد العمل الرطبة الآلية